01;05;11;12

## О перемещениях атомов в двухслойной системе Al/Ni под действием бомбардирующих ионов с близкими к порогу распыления энергиями

© Г.В. Корнич, Г. Бетц, А.И. Бажин

Запорожский технический госуниверситет, Украина Inst. f. Allgemeine Physik, Technische Universitat Wien, A-1040, Wien, Austria Донецкий государственный университет, Украина

Поступило в Редакцию 19 ноября 1999 г.

Выполнено молекулярно-динамическое моделирование столкновительных каскадов атомов в монокристалле Ni и системе, состоящей из монослоя атомов Al на поверхности Ni (100) при температуре 300 K и нормальной бомбардировке ионами Ar и Xe с энергиями 25 и 50 eV. Получено, что количество перемещений атомов через границу раздела Al/Ni существенно больше, чем количество аналогичных перемещений в монокристалле Ni.

При ионной бомбардировке многокомпонентных пространственнонеоднородных систем химические взаимодействия, определяющие взаимную растворимость компонент, могут оказывать влияние на величины вызванных столкновительными процессами переноса уширений границ раздела между компонентами [1–3]. Молекулярно-динамическое (МД) моделирование позволяет учитывать влияние химических сил на перемещения атомов в каскадах на уровне потенциалов атом-атомного взаимодействия [4,5]. В настоящей работе выполнено МД моделирование каскадов столкновений, вызванных нормально падающими на поверхность мишени ионами Ar и Xe с энергиями 25 и 50 eV. Рассмотрены две мишени при 300 К: двухкомпонентная система, состоящая из одного атомного слоя Al на поверхности кристалла Ni (100) и монокристалла Ni с такой же ориентацией поверхности по отношению к ионам. Цель работы — оценка влияния химических сил на каскадные перемещения атомов в Al/Ni путем сравнения среднего количества перемещений за один каскад в Al/Ni и Ni.

В работе был использован МД алгоритм, в котором взаимодействия между атомами описывались многочастичным потенциалом [6], подсоединенным при больших энергиях к потенциалу ЗБЛ [7]. Ион-атомное взаимодействие также описывалось потенциалом ЗБЛ. движения частиц решались методом Верлета [8]. Монокристалл Ni состоял из 4032 атомов, а двухслойный кристалл АІ/Ni — из 3944 атомов. Атомы в обоих кристаллах располагались в 14 слоях. В первом слое кристалла Al/Ni по периметру поверхности отсутствовали два ряда атомов А1, исключенные с целью предотвращения нефизических искажений поверхности из-за различия постоянных решетки Al (4.05 Å) и Ni (3.52 Å) [9,10]. Первый слой атомов Al повторял решеточный порядок подложки Ni (100). Температура моделировалась путем погружения мишени в среду с заданной температурой [11]. Начальные координаты ионов, падающих в элементарную область поверхности [12], вычислялись по закону случайных чисел. Во всех случаях было выполнено по 200 каскадов. Каждый каскад отслеживался в исходном кристалле в течение 4 рѕ.

Как видно из табл. 1 и 2, количество перемещений атомов из первого слоя (Al) в подложку (Ni) и наоборот в Al/Ni соответственно в 2.5 и 3.2 раза больше, чем в монокристалле Ni для ионов Ar с энергией 50 eV. Перемещения в Ni и Al/Ni из первого слоя в объем, скомпенсированные цепочками замещений, приводящими к обратным перемещениям атомов из объема кристалла в первый слой, включая обменные перемещения атомов между первым и вторым слоями, составляли соответственно 74 и 95%, в том числе обменные перемещения между первым и вторым слоями — 67 и 83% от общего числа перемещений из первого слоя в объем. При бомбардировке ионами Xe с энергией 50 eV количество

**Таблица 1.** Адатомы, обменные перемещения атомов между 1-м и 2-м слоями, перемещения атомов между 1-м слоем и объемом кристалла в Ni

Ni		Адатомы	1-й ↔ 2-й	1-й $ ightarrow$ объем	1-й ← объем
Ar	50 eV	0.52	0.31	0.46	0.34
	25 eV	0.125	0.13	0.13	0.13
Xe	50 eV	0.48	0.32	0.56	0.33
	25 eV	0.255	0.26	0.26	0.27

Письма в ЖТФ, 2000, том 26, вып. 9

**Таблица 2.** Адатомы, обменные перемещения атомов между 1-м и 2-м слоями, перемещения атомов между 1-м слоем и подложкой в Al/Ni

Al/Ni		Адатомы	1-й ↔ 2-й	1-й $ ightarrow$ объем	1-й ← объем
Ar	50 eV	2.195	0.955	1.145	1.085
	25 eV	0.95	0.295	0.295	0.295
Xe	50 eV	2.91	1.29	1.51	1.5
	25 eV	0.95	0.495	0.505	0.515

перемещений атомов Al в Ni подложку и наоборот в двухслойной системе Al/Ni было соответственно в 2.7 и 4.5 раза больше, чем в монокристалле Ni. При этом атомы Al в Al/Ni и атомы первого слоя в монокристалле Ni пересекали границу между первым и вторым слоями соответственно в 98 и 60% случаев в результате скомпенсированных перемещений, в том числе в 85 и 57% случаев в результате обменных перемещений.

Бомбардировка монокристалла Ni ионами Xe с энергией  $25\,\mathrm{eV}$  приводила к образованию в два раза большего количества перемещений атомов между первым и вторым слоями, 96% которых — обменные, по сравнению с ионами Ar, для которых все перемещения атомов в кристалле Ni — обменные. В Al/Ni при такой энергии ионов Ar также наблюдались только обменные перемещения атомов между первым и вторым слоями, количество которых превышало количество аналогичных перемещений в монокристалле Ni более чем в 2 раза. Для ионов Xe помимо обменных перемещений атомов в Al/Ni между монослоем Al и Ni подложкой, которых в 2 раза больше, чем при бомбардировке монокристалла Ni ионами Xe и Al/Ni ионами Ar, наблюдалось  $\sim 0.05$  перемещений/ион в самой подложке.

Для обоих ионов с энергией 50 eV из 3-6-го атомных слоев системы Al/Ni образовывалось в 3.7-4.0 раза больше перемещений атомов Ni в сторону бомбардируемой поверхности по сравнению с перемещениями атомов в монокристалле Ni. Такая разница в количестве обратных перемещений атомов внутри кристаллов связана с большим числом не являющихся обменными приповерхностных перемещений атомов в Al/Ni, которые влекут за собой атомные перемещения в более глубоких слоях.

3 Письма в ЖТФ, 2000, том 26, вып. 9

При бомбардировке ионами Ar с энергией 50 eV количество атомов, перешедших на поверхность кристалла (адатомы), было больше в Al/Ni по сравнению с Ni в 4.3 раза, а при энергии 25 eV — в 7.5 раз. Для ионов Хе с энергиями 50 и 25 eV количество адатомов было больше в Al/Ni соответственно в 6.0 и 3.7 раз. Ни в одном из случаев при энергии 50 eV количество адатомов, вышедших из второго слоя, не превышало 5% от их общего числа, а при энергии 25 eV адатомы, вышедшие из второго слоя, не появлялись. Большому количеству адатомов на поверхности Al/Ni способствует в первую очередь относительно небольшая энергия связи поверхностных атомов АІ. Так, при ОК разность потенциальных энергий идеального кристалла Al/Ni и кристалла без одного поверхностного атома и без учета релаксации решетки была 3.9 eV, тогда как для кристалла Ni — 5.2 eV [6,9]. О роли поверхностных энергий связи говорит также то, что модельный коэффициент распыления Al/Ni ионами Ar с энергией 50 eV был 0.06 at/ion, тогда как распыление Ni отсутствовало. Распыление ионами Хе не было обнаружено ни в одном из моделируемых случаев.

Во всех рассмотренных случаях обратнорассеянные ионы уносили  $\sim 10\%$  энергии при начальной энергии ионов  $50\,\mathrm{eV}$  и  $\sim 20\%$  при энергии 25 eV, исключая случай бомбардировки монокристалла Ni ионами Ar, при котором уносимая энергия составила ~ 20 и 40% соответственно. При этом ионы не проникали в кристаллы глубже первого атомного слоя, исключая ионы Xe с энергий 50 eV, которые оставляли во втором слое в среднем 8.5 eV. Таким образом, различия в распределениях упругих потерь энергии ионов в Ni и Al/Ni могут только незначительно, как например в случае ионов Ar на Ni, влиять на результирующую разницу в количестве перемещений. С другой стороны, моделирование системы Al/Ni при 0 K, детали которого выходят за рамки настоящего обсуждения, показало, что взаимная перестановка одной пары атомов Al и Ni местами в первом-втором слоях приводит к понижению потенциальной энергии двухслойного кристалла Al/Ni на 0.6 eV [9]. Это качественно согласуется с отрицательным значением теплоты перемешивания для системы AlNi [2]. образом, активированный бомбардирующими ионами процесс обменных и взаимно скомпенсированных перемещений атомов Al и Ni между первым и вторым слоями в Al/Ni является энергетически выгодным, что способствует общему росту количества перемещений атомов из первого слоя Al в положку и наоборот. При этом обменные и скомпен-

Письма в ЖТФ, 2000, том 26, вып. 9

сированные перемещения в двухслойном кристалле Al/Ni составляют более значительную часть от общего числа перемещений из первого слоя в подложку по сравнению с аналогичными перемещениями в монокристалле Ni при энергии ионов 50 eV, что качественно согласуется с результатами, полученными при моделировании двухслойной системы Ni/Au [13].

В рассмотренных условиях ионы Xe генерируют, как правило, больше адатомов и атомных перемещений в Ni и Al/Ni, чем ионы Ar. Это в значительной мере является результатом вызываемых ионами Xe на начальной стадии каскадов больших повреждений атомной решетки, приводящих к локальному на время  $\sim 0.5$  ps понижению потенциальных барьеров на пути миграции атомов в каскадах столкновений.

## Список литературы

- [1] Collins R. // Radiat. Eff. 1986. V. 98. P. 167-186.
- [2] Miotello A., Kelly R. // Surf. Sci. 1994. V. 314. P. 275-288.
- [3] Cheng Y.-T. // Mater. Sci. Rep. 1990. V. 5. P. 45–97.
- [4] Chladek J., Betz G. // Rad. Effects and Defects in Solids. 1997. V. 142. P. 51–62.
- [5] Gades H., Urbassek H.M. // Phys. Rev. B. 1995. V. 51. P. 14559–14569.
- [6] Gao F., Bacon D.J., Ackland G.J. // Phil. Mag. A. 1993. V. 67. P. 275-288.
- [7] Biersack J.P., Ziegler J.F. // Nucl. Instr. and Meth. B. 1982. V. 141. P. 93-99.
- [8] Haile J.M. Molecular Dynamics Simulation Elementary Methods. Wiley-Interscience. New York, 1992. 386 p.
- [9] Kornich G.V., Betz G. // Nucl. Instr. and Meth. B. 1998. V. 143. P. 455-472.
- [10] Kornich G.V., Betz G., Bazhin A.I. // Nucl. Instr. and Meth. B. 1999. V. 153. P. 383–390.
- [11] Berendsen H.J., Postma J.P.M., Gunsteren W.F.V. et al. // J. Chem. Phys. 1984. V. 81. P. 3684–3690.
- [12] Betz G., Pellin M.J., Burnett J.W., Gruen D.M. // Nucl. Instr. and Meth. B. 1991. V. 58. P. 429–437.
- [13] Sprague J.A., Gilmore C.M. // Thin Solid Films. 1996. V. 272. P. 244-254.